속보 자료

투자자 관계 담당:

언론 관계 담당:

Ed Lockwood

전무 이사, 투자자 관계 담당

+1(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

Meggan Powers

전무 이사, 기업 커뮤니케이션

+1(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor™, eDR™-7000 전자-빔 웨이퍼 결함 Review 시스템 발표

20nm 이하 디바스 결함을 위한 새로운 감도 및 처리량에서 업계 선두주자로 떠오른 KLA,

2011년 8월 15일 캘리포니아 주 밀피타스 - KLA-Tencor Corporation™ (NASDAQ: KLAC)은 오늘 20nm 이하 디바이 노드에서 칩을 생산하기 위한 핵심 도구인 eDR™-7000 전자-빔(e-빔) 웨이퍼 결함 Review 시스템을 발표했다. 업계 최고의 감도 및 처리량이라는 기술 혁신을 달성한 eDR-7000은 오늘날의 첨단 환경에서 결함을 이미지화하고 분류 문제를 해결한다—수율을 떨어뜨리는 결함이 요즘의 첨단 환경 하에서는 10nm에 불과하거나 또는 깊은 홈이나 contact hole 바닥에서 발견될 수 있다. 또한 eDR-7000은 20nm 노드용 웨이퍼 결함 Review 시스템의 감도 한계치에이르는 수준까지 안정적으로 결함을 찾아낸다는 점에서 동급 유일의 제품이다. 여기에는 지난 달발표된 Surfscan® SP3을 비롯하여 KLA-Tencor에서 곧 출시하는 패턴형 웨이퍼 검사 제품군의모델도 포함된다.

"eDR-7000은 웨이퍼 상의 결함 위치에 대해 완전히 이해할 수 있는 기회를 제공합니다." KLA-Tencor의 부사장이자 e-빔 총괄 책임자인 Cecelia Campochiaro 박사의 말이다. "이번 신제품은 기존 검사 시스템에서 놓치기 쉬웠던 10nm 결함을 Re-detection하여 이미지화 합니다. eDR-7000은 초당 여러 개의 결함을 리뷰할 수 있는데, 그 이유는 결함 위치까지 고배율(small FOV)로 직접 구동할 수 있기 때문입니다. 낮은 배율에서 결함을 찾아내고 선명한 이미지를 얻기 위해 줌 인하면서 시간을 소비하는 중간 과정이 필요 없습니다. eDR-7000은 질과 양에 있어 뛰어난 데이

터 처리능력을 가지고 있어 엔지니어들은 결함 위치를 정확히 파악하고 그 정보를 바탕으로 적절한 대응 조치를 취할 수 있습니다."

기존 eDR-5210 플랫폼을 능가하는 eDR-7000의 최신 기능은 다음과 같은 새로운 기능과 **향상** 된 점 덕분에 실현될 수 있었다.

- 현장에서 입증된 3세대 e-빔 이머전 컬럼(immersion column)으로 고해상도 및 향상된 topographic이미지화 가능,
- advanced stage및 vibration- isolation 시스템으로 결함 좌표 정확성 3배 향상 및 throughput 최대 4배 증가,
- 에너지 분산형 X-선(EDX) 분석 강화를 포함하여 베어 웨이퍼에서도 크게 향상된 감도,
- 유일한 레티클 결함 Review 모드가 있으며 레티클 결함이 발생했을 가능성이 있는 웨이퍼 지점을 신속하게 검사.
- 크게 빨라진 공정 윈도우 characterization,
- e-빔 웨이퍼 검사 데이터를 위한 VC(voltage contrast)이미징 모드,
- 이미지화 작업에 대한 가용성을 증대시키는 오프라인 결함 분류 기능.

메모리, 파운드리, 장비 제조의 선두 업체들로부터 이미 eDR-7000 시스템에 대한 주문이 이루어진 상태이다. 이미 여러 시스템이 첨단 개발 및 생산 라인에서 사용되고 있다. 높은 성능과 생산성을 유지할 수 있도록 eDR-7000 도구는 KLA-Tencor의 종합적인 글로벌 서비스 네트워크를 통해지원되고 있다. KLA-Tencor의 e-빔 검사 시스템에 대한 자세한 정보는 제품 웹사이트 http://www.kla-tencor.com/defect-review/edr-7000-series.html에서 찾아볼 수 있다.

KLA-Tencor 소개:

KLA-Tencor Corporation(NASDAQ: KLAC)은 공정 제어 및 수율 관리 솔루션 공급업체의 선두 기업으로서 전 세계 고객들과 협력하여 최첨단 검사 및 측정 기술을 개발하고 있다. 이러한 기술들은 반도체, 데이터 스토리지, LED, 광전지 및 기타 관련 나노전자 산업에 사용된다. 업계 표준의

제품 포트폴리오와 세계적인 수준의 엔지니어 및 연구원들로 이루어져 있으며, 30 년 이상, 고객들을 위해 우수한 솔루션을 만들어 왔다. KLA-Tencor 본사는 미국 캘리포니아주 밀피타스에 위치해 있으며 전 세계적으로 고객 영업 및 서비스 전담 센터를 운영하고 있다. 자세한 정보는 www.kla-tencor.com 참조. (KLAC-P)

전망:

이 보도자료에 명시된 내용 중 과거 사실 이외의 진술, 즉 eDR-7000의 성능 예측, 반도체 산업의 동향 및 (그 관련 예상 문제들), KLA-Tencor 고객의 eDR-7000의 사용 예측, KLA-Tencor의 신규 검사 시스템 도입 예상, 예상 비용, eDR-7000 도구 사용자가 체감할 수 있는 성능과 기타 이점에 관한 진술 처럼 미래에 대한 전망의 내용들은 1995년에 제정된 증권민사소송개혁법의 면책 규정이 적용된다. 이러한 전망에 대한 내용은 현재 정보와 예측을 근거로 이루어졌으며 많은 위험성과 불확실성이 수반되어 있다. (비용이나 성능 문제 또는 그 밖의 이유로 인한) 신기술 적용의 지연, KLA-Tencor 제품의 실행이나 사용에 영향을 주는 예상치 못한 기술적 어려움이나 한계, 다른회사의 경쟁 제품의 도입 등 다양한 요인으로 인해 실제 결과는 위에 기술된 내용과 다를 수 있다.